

* 理研での作業期間

* 2/08(Wed) - 2/10(Fri)

* 2/04(土) @大学

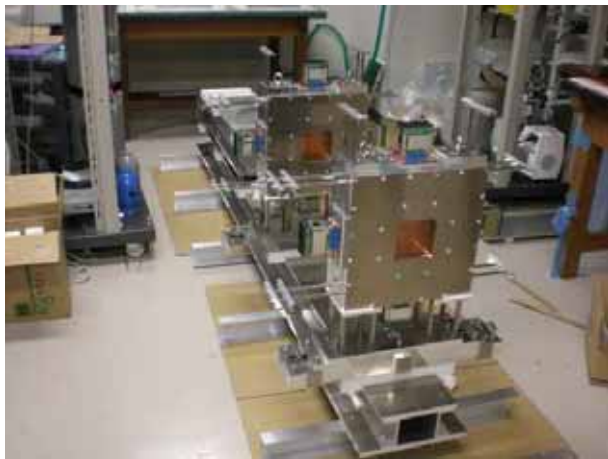
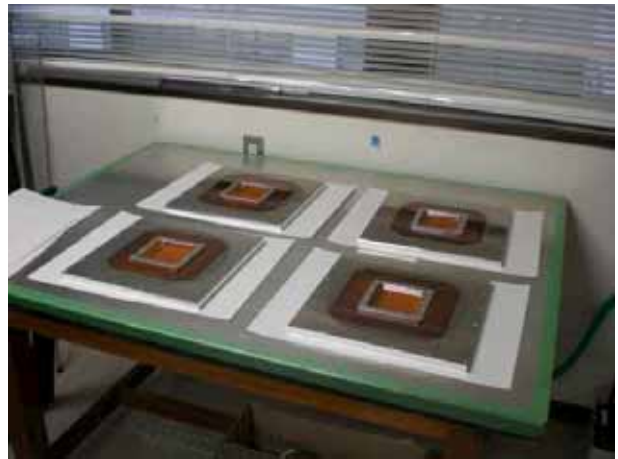
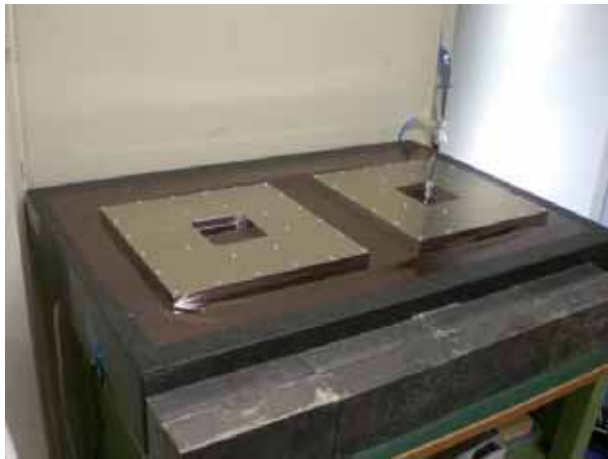
* BDC フランジ 4 枚へカプトン膜を接着

* 2/05(日)

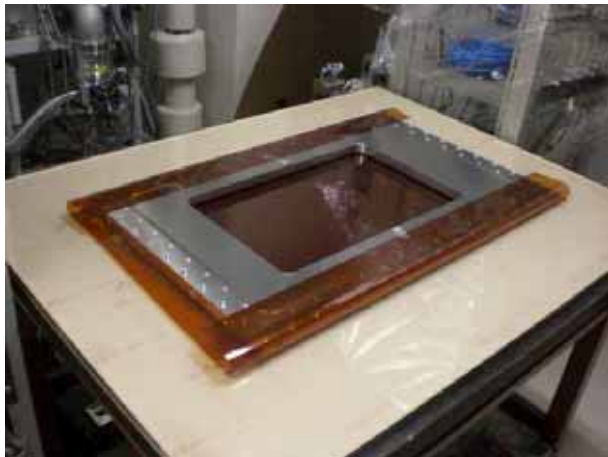
* BDC フランジ接着の一部をやり直し

* 接着剤の除去、清掃、再接着

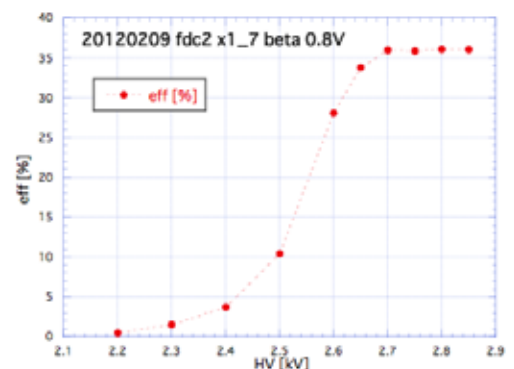
* BDC 2 台を架台上に仮設置試験



- * 2/06(月) - 2/08(水) : 修士論文審査会
- * 2/06(月)
 - * FDC1 フランジ 2 枚へカプトン膜を接着
- * 2/07(火)
 - * FDC1 フランジ上流側 : 接着剤をはがしてやり直し
 - * 夕方 : 橋本さん通夜
- * 2/08(水)
 - * FDC1 上流側フランジ : OK
 - * 昼 : 橋本さん告別式
 - * 夜 : 修士論文判定会議



- * 2/09(木)
 - * 理研へ : 雪で新幹線遅れる
 - * FDC2 試験
 - * Gas= He+50%C2H6, $V_{th} = 0.8 \text{ V}$, HV= 1.0 - 3.0 kV
 - * 何回か 2.8 kV で trip. HV conditioning 不足?
 - * シンチレータ 2 枚をトリガーに scaler で効率を測定
 - * HV= 2.75 kV で動きそう
 - * He/CH4 より HV が低い
 - * FDC1 配線
 - * ASD-PS x3 (left to right)
 - * X1-1, U1-1, V1-1, X2-1, U2-1
 - * X1-2, U1-2, V1-2, X2-2, U2-2
 - * V2-1, X3-1, nc, X1p-1, U1p-1
 - * V2-2, X3-2, nc, X1p-2, U1p-2
 - * V1p-1, X2p-1, U2p-1, V2p-1, X3p-1
 - * V1p-2, X2p-2, U2p-2, V2p-2, X3p-2
 - * VME-TDC x7 (left to right)
 - * x1-1, x1-2, u1-1, u1-2 (left)
 - * v1-1, v1-2, x2-1, x2-2



- * u2-1, u2-2, v2-1, v2-2
- * x3-1, x3-2, x1p-1, x1p-2
- * u1p-1, u1p-2, v1p-1, v1p-2
- * x2p-1, x2p-2, u2p-1, u2p-2
- * v2p-1, v2p-2, x3p-1, x3p-2 (right)

* 2/10(Fri)

- * FDC2 cosmic data continued
- * 上流用架台を E6 から B 2 に移動

* 2/11(Sat) @大学

- * BDC1, 2 用の低圧ガス処理系を 2 台製作

* 2/12(Sun) @大学

- * FDC1, ICF 用保護板製作